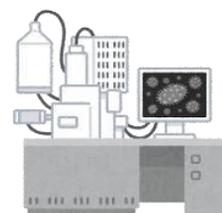




最新高速イオンミリングの講義・ FE-SEM試料作製ワークショップ



概要

FE-SEMによる断面観察は、微小な製品の評価（構造解析、不良解析、成膜状況等）に有効な手法の1つですが、観察をスムーズに行うためには、前処理としての断面作製技術が欠かせません。その迅速で平滑な断面作製に、イオンミリングは有効です。

今回、少人数での研修を行います。断面作製にお困りの方、新たに活用したい方など、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

日程・定員 令和6年7月10日（水）10：00～17：00のうち、2時間
（講義1時間+デモ・実習1時間を1単位として3回実施）

	日程		定員	備考
①	10：00～11：00	講義	3名程度	開始15分前より 受付開始
	11：00～12：00	デモ・実習		
②	13：00～14：00	講義	3名程度	
	14：00～15：00	デモ・実習		
③	15：00～16：00	講義	3名程度	
	16：00～17：00	デモ・実習		

※ ①②③のうち、ご希望の回をお申込みください。各回の内容は同一のものです。

※ お申込み多数の場合は、1社1名とさせていただきます。

受講料 無料

会場 大分県産業科学技術センター 第2研修室及びB204-1
（大分市高江西 1-4361-10）

講師 日本電子株式会社 エンジニア

お申込み・お問合せはこちら

申込方法 URL、または二次元コードからアクセスの上、お申込みください
<https://tzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/r6-mil>

申込締切 令和6年7月3日（水）

お問合せ 大分県産業科学技術センター 工業化学担当 上野、安部
TEL：097-596-7101、E-mail：i-chem@oita-ri.jp



※当日は、セミナーの様子を写真撮影して広報等に使用することがあります。

※お申込みいただいた内容は、本セミナーの運営管理に利用し、他の目的で利用することはありません。

